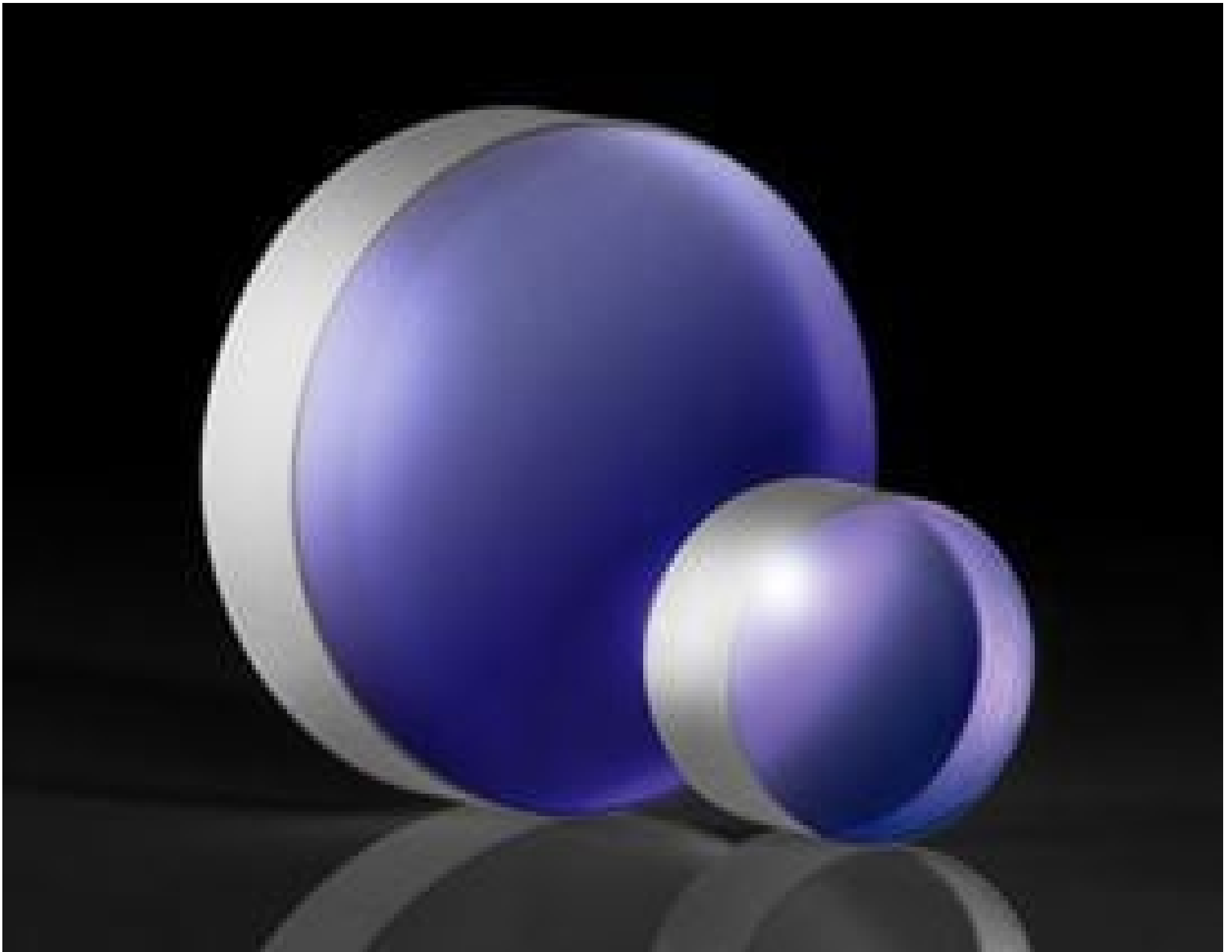


## Ti:Saphir-Laserlinienspiegel aus Quarzglas, 12,7 mm Durchmesser, 6,35 mm Dicke, 800 nm, 45° AOI



Produkt #28-986 **3 In Stock**

- 1 + €145<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1-5	€145,00 stückpreis
Stk. 6-25	€116,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

**i** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Produktdetails

Ti:Sapphire Laser Mirror

Typ:

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

6.35 ± 0.20

Dicke (mm):

Freie Apertur CA (mm):

11.43

**Durchmesser (mm):**  
12.70 +0.00/-0.10

**Parallelität (Bogenminuten):**  
<3

**Kanten:**  
Fine Ground

## Optische Eigenschaften

**Substrat:** □  
Fused Silica (Corning 7980)

**Oberflächenqualität:**  
10-5

**Einfallswinkel (°):**  
45

**Beschichtung:**  
Laser Mirror (800nm)

**Designwellenlänge DWL (nm):**  
800

**Wellenlängenbereich (nm):**  
780 - 820

**Oberflächenebenheit (P-V):**  
λ/10

**Beschichtungsspezifikation:**  
R<sub>abs</sub> S & P >99.80% @ 400nm @ 45° AOI  
R<sub>avg</sub> >99.5% @ 390 - 410nm @ 45° AOI

## Konformität mit Standards

**Konformitätszertifikat:**  
[Anzeigen](#)

## Produktdetails

- >99,8% Reflexion bei Ti:Saphir-Grundfrequenz und -Harmonischen
- Oberflächenqualität 10-5 sorgt für reduzierte Streuung in Laseranwendungen
- Hohe Laserzerstörschwelle

Die TECHSPEC® Ti:Saphir-Laserlinienspiegel bieten >99,8% Reflexion für die Grundfrequenz und harmonische Frequenzen von Ti:Saphir-Lasern bei 45° und 0-45° Einfallswinkel. Die Laserspiegel bestehen aus Quarzglassubstraten, die eine hervorragende thermische Stabilität bieten, und sind für 800 nm oder 400 nm beschichtet (die Grundwellenlänge und die zweite Harmonische). Um Streuung zu reduzieren, haben die Spiegel eine Oberflächenqualität von 10-5 und eine Oberflächenebenheit von λ/10. Die TECHSPEC® Ti:Saphir-Laserlinienspiegel sind ideal für verschiedenste Anwendungen mit Ti:Saphir-Lasern geeignet, z. B. die Multiphotonenbildgebung, die Ultrakurzpuls-Spektroskopie und die kalte Mikromaterialbearbeitung.